

Установка ионного распыления НИКА-153



Установка вакуумного напыления Ника-2013-500 предназначена для двухстороннего напыления прозрачных проводящих покрытий ($\text{In}_2\text{O}_3:\text{SnO}_2$) на слои органических и металлоорганических полупроводников с контролем толщины получаемой пленки по свидетелю сопротивления. Установка имеет автоматическое программное управление, обеспечивающее проведение технологического процесса в режимах:

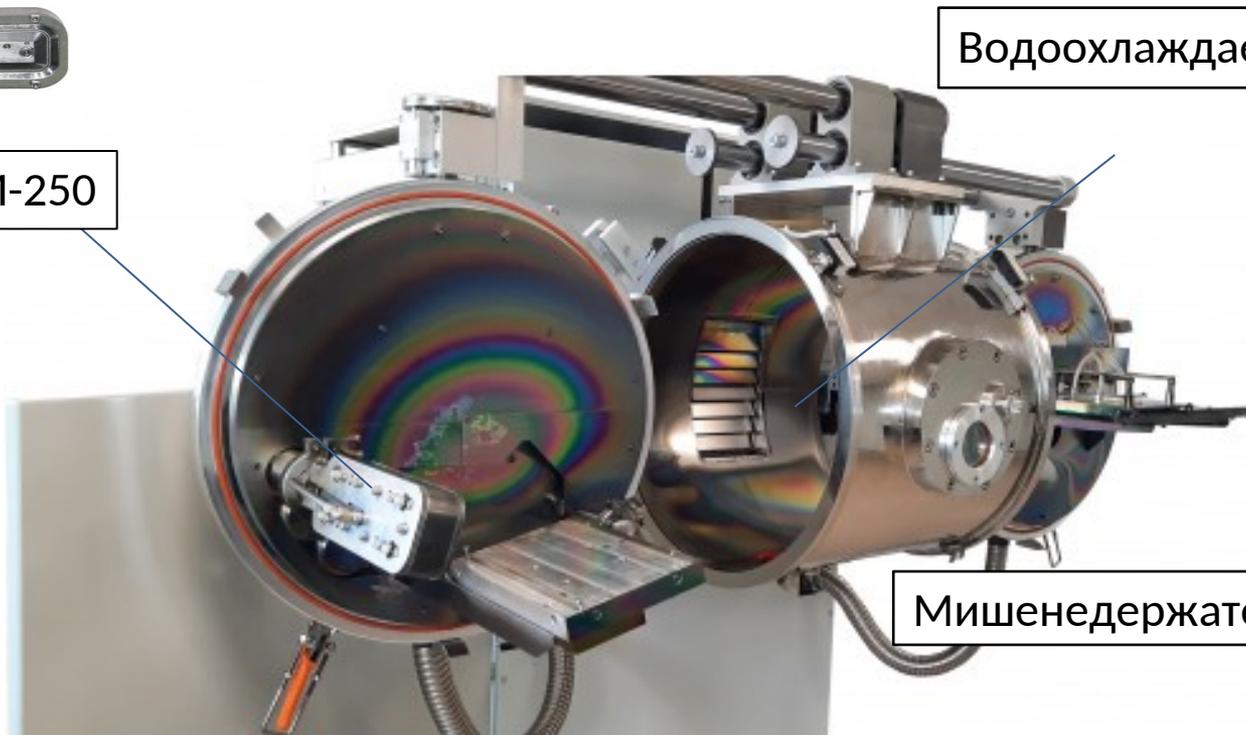
- наладочный режим - управление механизмами и устройствами для выполнения наладочных, ремонтно-профилактических работ;
- ручной режим - управление элементами установки с соблюдением всех блокировок, исключающих возникновение внештатных ситуаций;
- автоматический режим - реализация автоматического цикла
- технологической программы (технологического рецепта)

Вакуумная камера установки оснащена:

- источником ионов ИИ-250;
- водоохлаждаемым столом;
- водоохлаждаемым мишенедержателем.



Источник ионов ИИ-250

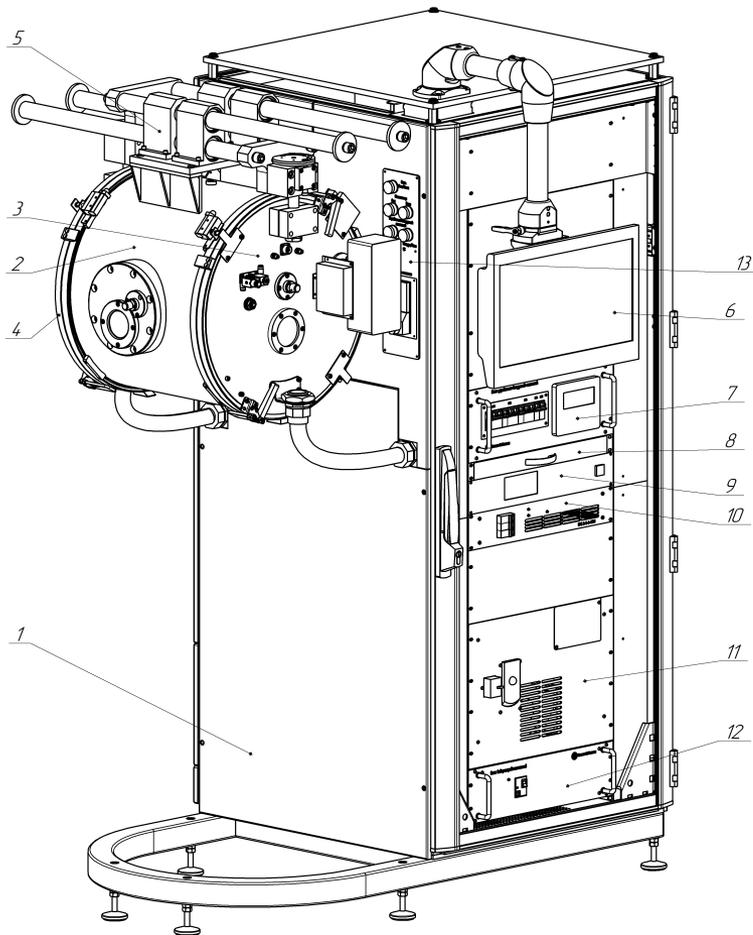


Водоохлаждаемый стол

Мишенедержатель

Вакуумная камера установки оснащена:

- водоохлаждаемым столом;
- водоохлаждаемым мишенедержателем;
- источником ионов ИИ-250



- 1 - каркас;
- 2 - вакуумная камера;
- 3 - фланец передний;
- 4 - фланец задний;
- 5 - подвес;
- 6 - монитор;
- 7 - блок управления вакуумной системой (БУВС);
- 8 - полка с клавиатурой и мышью;
- 9 - контроллер турбомолекулярного насоса;
- 10 - блок питания ионного источника;
- 11 - СОВА;
- 12 - блок водораспределительный (БВР);
- 13 - панель управления.

Установка НИКА-153

Размещение

